

## ファインMEMSプロジェクト中間成果発表会

主催：ファインMEMSプロジェクト推進連絡会 / (財)マイクロマシンセンター

### (1) 開催主旨

MEMS産業の発展を支える基盤技術として平成18年度から3年間の予定でスタートしましたNEDOプロジェクト「高集積・複合MEMS製造技術開発プロジェクト」(ファインMEMS)の中間成果を紹介します。

ファインMEMSプロジェクトは、微小三次元化構造加工の高度化と、ナノ部材・異種材料の活用による機能の複合化・集積化を図るための製造基盤技術を開発するものです。

### (2) プログラム

NEDO委託・助成「高集積・複合MEMS製造技術開発事業」(平成18年度～平成20年度) ファインMEMSプロジェクト中間成果発表会		
日時：2007年7月27日(金) 13:00～16:30 会場：東京ビッグサイト 西3ホール内 特設会場 主催：ファインMEMSプロジェクト推進連絡会 / (財)マイクロマシンセンター 参加費：無料		
司会：(財)マイクロマシンセンター 小池 智之		
<b>セッション1</b>	<b>オープニング</b>	
13:00～13:05	来賓挨拶	(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 高安 正躬
13:05～13:10	来賓挨拶	経済産業省(予定)
13:10～13:25	ファインMEMSプロジェクトの概要	ファインMEMSプロジェクト推進連絡会 座長 下山 勲 東京大学 大学院情報理工学系研究科 研究科長 教授
<b>セッション2</b>	<b>ファインMEMSプロジェクト委託事業の成果発表(1)</b>	
13:25～13:45	選択的ナノ機械構造体形成技術	東京大学 大学院情報理工学系研究科 研究科長 教授 下山 勲
13:45～14:05	バイオ材料(タンパク質など)の選択的修飾技術	(独)産業技術総合研究所 バイオニクス研究センター 研究員 鈴木 祥夫
14:05～14:25	ナノ材料(CNTなど)の選択的形成技術	(独)産業技術総合研究所 ナノカーボン研究センター チーム長 畠 賢治
14:25～14:30	休憩	
<b>セッション3</b>	<b>ファインMEMSプロジェクト委託事業の成果発表(2)</b>	
14:30～14:50	MEMS・半導体プロセス統合モノリシック製造技術 (新たなセンシング原理の探求)	立命館大学 理工学部 教授 鳥山 寿之
14:50～15:10	MEMS・半導体横方向配線技術 (高密度な低温積層一体化実装技術)	(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 グループ長 明渡 純
15:10～15:30	MEMS・半導体横方向配線技術 (高密度な低温積層一体化実装技術)	東北大学 工学研究科 教授 小柳 光正
15:30～15:50	多層ウェハレベル接合体の 低ストレスダイシング技術	(財)レーザー技術総合研究所 主任研究員 藤田 雅之
<b>セッション4</b>	<b>クロージング</b>	
15:50～16:00	ファインMEMS知識データベースについて	(財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一
16:00～16:30	技術相談コーナー	展示会場C-032ブース